

Sensofar 社より新型 S neox 3D 測定顕微鏡発売

スピードを追求した新しい三次元表面形状・面粗さ計測



株式会社日本レーザー（本社：東京都新宿区西早稲田 2-14-1、代表取締役社長：宇塚達也）が日本総代理店を務める Sensofar Metrology（センソファー・メトロロジー 本社：スペイン Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra. BV-1274, KM 1, 08225 Terrassa CEO: Marc Canales）は、その主力製品である光学式形状測定装置 S neox の第 5 世代を発売した。

S neox はレーザー顕微鏡の基本原則である共焦点法に加え、光干渉法、焦点移動法を 1 台に搭載した 3-in-1 が特長の高速 3D 形状測定装置。新型モデルは従来の 5 倍もの高速化を実現。機能性、効率性、性能全てにおいて他を凌駕する。

概算税抜価格は約 1,500 万円。以下のような用途向けに、初年度 10 台を目標として販売する。

《主な用途》

- 粗さ計測（機械仕上げ面、電極表面等）
- 透明なフィルムやコーティングの膜厚計測
- PCB 回路パターン
- 機械工具の刃先形状計測
- 高速測定を活かした品質検査
- レーザーテクスチャリング

新型 Sneox について

S neox は、サブナノ/ナノ/マイクロスケールの形状測定を目的として設計され、先端的な検査・分析に対応する顕微鏡型の高性能非接触 3D 光学式形状測定顕微鏡システムである。

新型 S neox で最大の特徴はそのスピードで、マイクロディスプレイ走査共焦点顕微鏡などの独自技術により、従来の 5 倍に相当するデータ取得速度 180 fps を実現した。加えて研究開発や品質管理試験室に求められる高い柔軟性、安定性、耐久性兼ね備え、その使いやすいインターフェースにより、品質管理環境での 24 時間連続稼働の活用が可能。Sneox 最大の特長である 3-in-1 テクノロジーのアプローチ、共焦点法、光干渉法、アクティブ照明焦点移動法(新方式)は、汎用性とデータ取得の最適化に大きく貢献する。

《主な新機能》

- 高速化(従来比:5 倍)
- 新方式(アクティブ照明焦点移動法)および HDR(ハイダイナミックレンジ)アルゴリズムの採用により、鏡面や透明体の滑らかな表面の計測が可能に
- 薄膜計測モード:透明膜の膜厚(50 nm~1.5 μ m)を 1 秒以内で測定。迅速、正確、非破壊。
- 高解像度 5M ピクセルカメラ(従来比:約 4 倍)とスマートノイズ検出アルゴリズムにより、画質が格段に向上
- 微分干渉観察(DIC)機能:ナノメートル台の段差も明確に観察

Sensofar について

Sensofar-Tech, SL(商号「Sensofar Metrology」)は、表面測定分野において最高の品質基準を誇る最先端技術メーカー。研究開発や品質管理試験向けの標準装置と、生産工程向けのコンパクトなインラインソリューションそれぞれに、共焦点法・干渉法・焦点移動法の 3-in-1 高精度非接触 3D 表面測定システムを提供している。

Sensofar Metrology を含む Sensofar グループは、欧州のテクノロジー・イノベーションハブとして知られるスペインのバルセロナ近郊を本拠地とし、アジア、米国、独国にオフィスを持つほか、グローバルなパートナーネットワークを通じて 30 カ国以上で事業を展開している。

本件に関するお問合せ **株式会社日本レーザー**

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1

FAX 03-5285-0860 URL <https://www.japanlaser.co.jp/>

製品に関するお問合せ： **営業本部 システム機器部**

電話 03-5285-0862 e-mail meas@japanlaser.co.jp

プレスリリースに関するお問合せ： **営業本部 販売促進部 橋本和世**

電話 03-5285-0861 e-mail hasimoto@japanlaser.co.jp